低速電子衝撃による吸着氣體の脫離(第4報)

吸着水分子の層の厚さ並びに吸着素域の決定

石川義興

固體表面への氣體の吸消實驗は数多く行はれて,之等の結果を綜合する種々の等温吸着式も 多く呈出せられた¹⁾

就中, Langmuir の吸着式³は多くの實驗事實に可成よく適合するので, この吸着式が導き 出された根本假定, 即ち Langmuir の單分子層形成の假說は, 吸着氣體の壓力が甚しく大でな い時には, 實驗的にも理論的にも多くの支持を得てゐる.

併し多分子吸着層形成說も古くより行はれ、之を支持する事實も多く見出された。

固體表面が單分子層或は單原子層で截はれた場合に、ヴァン・デル・ヴァールス吸着或は他の 何らかの吸着が起らなくなるか, 尙吸着が進行して多分子層が形成せられるかは未だ…義的な 決定は困難である.

多くの吸着實驗が行はれたにも係らず、之が決定出來ないのは氣體を吸着し得る真の固體 の表面積を測定することが困難な爲である。. 巨視的には平滑な金属表面も結晶子 (crystallite) や裂罅 (fissure) が多く存在して、見掛けの表面積の數百倍にも塗する面積を有することさへ ある⁴. 斯る固體表面に於ては氣體の吸着量が如何に正確に測定出來ても、その吸着層の厚さ を決定することは出來ない。

表面積を決定する困難を避け、氣體の吸着量を測定せずに、直接に吸着層の厚さを知る方法 が種々工夫せられた、之等の方法には收容係數 (accomodation coefficient)⁹⁹, 熱電子放出 (thermionic emission)⁶⁹, 表面反射光の橢圓偏光 (elliptical polarization of light reflected from a surface)⁷⁹, 及び表面電位差 (surface potential)⁸⁹ 等の測定がある.

M. Polanyi, Verh. deut. phys. Ges., 18, 55 (1916).
 S. Brunauer, P. 11. Emmett and E. Teller, J. Am. Chem. Soc., 60, 309 (1938).
 S. Brunauer, L. S. Deming, W. F. Deming and E. Teller, J. Am. Chem. Soc., 62, 1723 (1940).

4) N. K. Adam, The Physics and Chemistry of Surfaces (Oxford, 1938) 246.

J. W. McBain, The Sorption of Gases and Vapours by Solids (Routledge, 1932).
 S. J. Gregg, The Adsorption of Gases by Solid (1934).

^{2) 1.} Langmuir, J. Am. Chem. Soc., 38, 2221 (1916).

⁵⁾ J. K. Roberts, Some Problems in Adsorption (Cambridge, 1939).

⁶⁾ J. H. de Boer, Electron Emission and Adsorption Phenomena (Cambridge, 1935).

⁷⁾ J. H. Frazer, Phys. Rev., 34, 644 (1929): S. Silvermann, ibid, 36, 311 (1930).

⁸⁾ H. K. Walley and E. K. Rideal, Proc. Roy. Soc., A 140, 484 (1933).

低速電子衝撃による吸着氣體の脫離 (第4報)

No. 5

191

著者は低速電子衝撃による吸着水分子の脱離を測定して先に吸着分子の電子狀態を知り得たがⁿ⁾,更に吸着水分子層の厚さ及び吸着素域 (elementary space)の半徑を決定することが出 來た。

實驗結果よりすれば、自金表面の水分子の吸着層は水の蒸氣壓が飽和に近い様な場合には百分子層にも達する厚い分子層を形成し、凝縮すら生するが、低壓に於ては、單分子層一高々數分子層一をなして吸着してゐる。斯る吸着層に於ては一箇の吸着分子の占める白金表面積,即 ち吸着素域 (elementary space) の大さは略吸着分子自身の大さに等しいことが判つた。

装置及び方法

装置及び方法は前報の論文™と全く同様であるので此處では省略する.

排 氣

二極管のガラス表面積は自金板の表面積約 1 cm² に比して著しく大である。随つてガラス 器壁表面の水の吸着量も自金のそれに比して甚だ大で、三極管の管壁の排氣並びに管壁の吸着 狀態に關して細心の注意が必要である。

二極管の管壁及び自金板は敷時間 350°C 以上に加熱排氣し,特に自金板は電子衝撃に依つ て赤熱し,吸破吸着氣體の排氣を行つた。常温に冷却後,二極管は液態空氣に浸したトラップ に依つて保護し,他の蒸氣の侵入してこれに吸着汚染するのを防いだ。この方法によれば,低 速電子衝撃によつては殆んど氣體の脱離が認められない良好な排氣狀態が得られる。

實驗結果

白金表面への水分子の吸着

二極管に通するトラップに水の極微量を導入して,排氣を行ひながら蒸發させると水分子は 一部分二極管に流入して白金板及びガラス管壁に厚い分子層をなして吸着するが,尚排氣を積 けると一端吸着した水分子が再び吸着表面より脱離する。

脱離した水分子は加熱陰極繊維に衝突した場合には分解して永久氣體を生する。 この氣體 の量をビラニ真空計を用ひて追跡測定すると水分子の蒸發經過を知る事が出来る。

最初はビラ=餌空計(感度10⁻⁶ mm.Hg)によつて測定出來ない程多量の永久氣體を生する が、約二時間程は急速に排氣量を減少し、その後は漸減する傾向を示す。

⁹⁾ 石川発興, 本誌 17, 176 (1943);

¹⁰⁾ 石川義興,本誌 16, 86, 119 (1942), 17, 176 (1943).

Vol. XVII

衝撃實驗を行ふには更に排氣を積行して,排氣量が極めて少なく且つ定常的になつた狀態に 迄排氣した・

脫離實驗

一定電壓(V)を掛けて放出する熱電子電流(i)を加速し、陽極白金板上に吸着してゐる水 分子に衝撃させた。この衝撃を蒙けた吸着水分子は或る少なる磁率 (10⁻³ 程度)を以て、白 金表面に於て解離、前期解離を生じ、原子及び遊離巷(OH) 或はそのイオンに分解する。分 解生成物は自己の行する運動エネルギーによつて吸着層を脱離するに至る。

三分間の衝撃を蒙けて脱離する永久氣體の量 4p をビラニ真空計を用ひて測定した。OH は 液態空氣の温度に迄冷却したトラップによつて捕集せられて¹⁰, ピラニ真空計には水素分子の みが集まる。



electron impact. (The curves i, 2, 3 in Fig. represent mono-, diand tri-molecular layer respectively.)

R. W. Campbell and W. H. Rodebush, J. Chem. Phys., 4, 293 (1936).
 K. H. Geib, *ibid.*, 4, 391 (1936).

電子衝撃實驗は初め低速度の電子に依つて試み、順次加速電圧を高め、6V-30Vの範圍に 互つて 0.3V より 0.5V の間隔を以て約 30 回行つた.

實驗結果は 4p/i と V の間の關係として第一圖に脫離曲線によつて表はした。

脫離曲線の特性

第一岡の脱離曲線に於て橫軸には電子の加速電壓をボルトを以て表した. 之の電壓は貨際 に適用した電壓より接觸電位差等に基く補正值 1.4 V を差引いて示した⁹. 縦軸は 4µ/i の大 いさを表した. 4p は電子衝撃による三分間の氣體の脱離量で, ビラニ真空計の振れ (cm) よ り測定した. i は一定電壓 (V) に依つて加速せられた衝撃電流 (mA) である.

脱離曲線の特性の第一は多くの屈曲點を有することで、この屈曲點に相當する電壓より吸着 分子の勵起電壓が測定出來ることは既に述べた處である⁹.

特性の第二は脫離曲線に高さを異にする三種の曲線が得られ、その外觀は夫々よく似てゐる 點である。

實驗より求めた 26本の脱離曲線に就て,比較的平坦な外觀を有する 10.5 V より 15 V の 範圍の 4p/i 値を測定し,_その値の出現回數とその値の大いさとの間の關係を求めて第二圖に 圖示した・



此處に與味あるのは 4p/i の値の出現回數は連續な分布を示さないで、特に 4p/i の値 3, 6、9 の附近に集中するのが見られる。これは脱離曲線の著しい第三の特性と考へられる。即 ち斯る 4p/i の値の不連續性は吸着層の特異な性質に基くものであることが想像出来る。 (原報) 石川 義興

Vol. XVII

一定加速電子電流の長時間連續衝撃による 小/i 値の變化

水の吸着層に對して, 衝撃電壓を變化せずに, 一定に加速した電子衝撃を長時間に互つて纖 續し, その間, *dp/i* 値の變化する模様を視た。第三圖は衝撃電子電流 0.3 mA, 加速電壓 11 V に於て數時間連續衝撃を行つた場合の經過で, 圖に於て擬軸には *dp/i* の値を, 橫軸には電 子衝撃を加へた時間を示す.



Fig. 3. The variation of $\Delta p/i$ by the impact of electrons at the definite voltage.

4p/iの値は二時間以上も略一定値 3, 6, 9 を保つてゐるが,時には衝撃開始後二時間を經 て念に 4p/i値が9より6に變化する場合がある。併し一度6に下ると 4p/iは更に二時以上 も同一値を保つてゐる。

この事實は先の脫離曲線の高さが不連続的な値 3, 6, 9 を取らうとする傾向と相關聯する もので、3, 6, 9 は 4p/i の特異値と考へられ、斯る現象は吸差層の構造の特異性に基くこと が想像出來る。

然し 4p/i 値が特異値を取らうとする傾向は 二極管の管壁を液態空氣に浸さない時にのみ 生ずるので、器壁吸着層が液態空氣によつて凍結せられた場合には 4p/i 値の特異性は見ら れない。

二極管壁の吸着水分子層の白金表面吸着層に及ぼす影響

前項に述べた如く, 實驗時の二種管壁の溫度が電子衝撃の脫離經過に大なる差異を生する. この原因は器壁吸着水分子層に依るものと考へられる.

二極管壁を作ってゐるガラスは一般に氣體の吸着に對して複雑な性質を示すもので,既に知る如く適當な排氣處理を加へると水素原子等に對して Clean up 效果を示すが¹⁰⁾,又多量の 氣體を吸着することも知られてゐる。 特に水に對しては表面に複雑なシリカゲルの層を生す No. 5

3¹²).

斯る器壁のガラスに對して加熱排氣處理 或ひは液態空氣を用ひて 冷却處理を行つた場合に 電子衝撃實驗に如何なる效果を生するかを以下に述べる。

i) 二極管の加熱處理の影響.

二極管に微量の水を導入して蒸發させて,器壁及び白金面に水の厚い吸着層を生じた後,單 にポンプによる長時間の排氣を積けた場合に第1圖の(1),(2),(3)曲線に相當する排氣狀 態が得られたが,排氣と同時に二極管壁の加熱を併用すると短時間(約一時間以內)で上と同 様な狀態に達する。

即ち 160°~200° 附近約 40 分加熱し器壁の排氣を行ふと第一圖の(3) に相當する吸着狀態 が得られ,220° 附近に同一時間加熱すると脱離曲線の(2) に相當する狀態が得られる。又二 極管を 200°C 附近に加熱しながら,同時に 300 V に加速した電子電流約 5 mA を以て約 3 時間自金板に衝撃すると,加速電壓 12 V 附近の低速電子衝撃によつては dp// の値が1 以 下を示す様な吸着量の非常に少ない狀態が得られる。

更に 350°C 以上に器壁を加熱排氣すると 50 V 以上に加速した電子の衝撃によつても殆ん ど氣臓の脱離を生じない完全に近い排氣狀態に達する事が出來る。 この場合勿論加熱と同時 に自金板には高速電子衝撃を加へて排氣する。

i) 二優管壁を 液態空氣で凍結す
 る場合・

水を二極管に流入し蒸發後, 直ち に二極管を液態空氣中に浸して, 器 壁吸着水分子を凍結させ, その蒸發 を防ぎ, 而る後白金板の吸着層に低 速電子衝撃を加へると 4p/i の値は 10.7 V の加速電壓の 場合に 於ても 260 以上に達し, 多量の水分子が白 金板に吸着してゐることが判る. 更 に衝撃實驗を續行し, 有回の 4p/i の値を測定し, その減少を調べると



約十囘の衝撃の後には Ap/i 値は 30 程度迄に減少することが判つた。

尙, 二極管の管壁を前と同様に液態空氣に浸して, 自金板の水の吸着量が比較的に多くない

R. G. Sherwood, J. Ann. Chem. Soc., 40, 1645 (1918).
 J. W. McBain, Sorption of Gases by Solids (1932), Chapt. vii.

. A 18

(原報)石川義興

Vol. XVII

狀態に於て電子衝撃による脫離實驗を行ひ、毎囘の衝撃實驗による 4小/i 値を測定し、之を 第四圖に圖示した。

第四圖に於て a 曲線は一定衝撃電慄 11 V に加速した電子電流による脱離を示し, b 曲線 は衝撃電壓を 10.6 V より 18.5 V 迄少し宛變じて脱離實驗を行つた場合の一例である。 兩曲 線に闘する實驗數値を第一表に表示した。

第四岡は第三岡に比較すると大に趣きを異にして、4p/i 値の特異値を取らうとする傾向は 見られず、電子の脱離能率 4p/i は毎回の衝撃實驗によつて連續的に減少する。

水分子と水素分子の共存吸着

適當な排氣處理によつて 4p/i の値が 10.5 V より 15 V 迄の範圍に於て 3, 6, 9 を示す様 な吸着層の狀態が安定に生するが, 更に器壁加熱排氣を併用すると 4p/i 値が 3 以下の値を 取る様な吸着量の少ない吸着層をも生する.

この様な種々の水の吸着層に對して水素を接觸させて水素吸着の影響を視た。水素は水銀 柱三糎程の壓力に於て二極管に導入して, 数時間放置後, 之を排出した。低速電子衝撃によつ て再び脱離曲線を測定し水素導入前後に於ける脱離曲線の變異を調べた。

第一間の(1),(2),(3) に相當する曲線は水素接觸による效果をあらはさないが、4p/i 値が 1 附近を示す脱離曲線に於ては第五圖に示す様に、水素特有の極大¹⁰⁾を 10 V 附近に生じ、 水素が水と同時に吸着してゐることが判る。



第五間の(a) は水素導入前の吸着水分子のみの脱離曲線を示し,(b) 曲線に水素導入後のもので水素と水との同時吸着の生じてゐるのを瞭らかにし得た。即ち 10 V 附近に於て生する脱離曲線の極大は水素分子の ${}^{1}S_{R} \rightarrow {}^{3}S_{n}$ 勵超に基く水素原子の脱離によるものである¹⁰.

論議

脫離機構

吸着水分子の低速電子衝撃による脱離機構に就て前報に於て詳細に論じ, 脱離現象が分子の 解離及び前期解離に基く事實を嘹らかにした^{9 10}

吸着層の構造

吸着分子が解難或は前期解難を生する為には,分子は一定速度に加速した電子と衝突しなければならぬ.吸着氣體分子の脱難量は有效衝突回数に比例するから、單位表面に於ける吸着分子の密度 e、電子電流 i 及び電子衝撃による解離確率 e の積に比例する. 從つて氣體の脱離 量は下式で表はすことが出来る.

$$\Delta p = \epsilon \cdot c \cdot i$$

(1)

(2)

脱離曲線の高さ 4p/i 即ち電子の脱離能率は上式より解離確率 e と吸着密度 e との積に等 しいことが判る。

然るに第一岡に瞭らかな如く, 脱離曲線は高さを異にする三種類を生じ, 而も第二岡に見られる如く, その高さ 4p/i の値は倍數的な關係を持つ一定値 3, 6, 9 に夫々集中する.

斯様に 4p/i 値が非連續的な値を取らうとする傾向は(1)式より考察すれば, 4p/i に比例 する吸着密度 c が非連續な値をとることによるものである。

然し多少の不規則性はあるにしても,同一原子が二次元的な排列をする金属表面に於て,單 分子吸着層が形成せられる場合に,吸着分子の密度が非連續的に變化するとは考へられない。 斯る非連續的な値を取る理由は常然吸着層の構造の多重性に歸せねばならね。

従つて第一闘の(1),(2),(3) に相當する曲線は夫々吸着層が單分子層,二分子層,三分子層を形成することによつて生じたものと考へられる。4p// の値に簡單な数値的な關係を持つのは層の構造の規則性に基因することを豫想させる。

今吸着層が三分子層よりなる場合に就で考へると

(1) 式を用ひて、第三届日を通過する場合、電子の脱離能率は下式で示される。

 $\Delta p_3 = \varepsilon_3 c_3 i$ \therefore $\Delta p_3 / i = \varepsilon_3 c_3$

第二層目を通過する場合には、電子の一部は第三層の吸着分子を解離させてそのエネルギー を失ふので一定加速された電子の数は減少する。

 $\Delta p_{\varepsilon} = \varepsilon_{2} c_{2} \left(i - \varepsilon_{3} c_{3} i \right) \quad \therefore \quad \Delta p_{2} / i = \varepsilon_{2} c_{2} \left(1 - \varepsilon_{3} c_{3} \right) \tag{3}$

(原報)石川義興

更に第一層目を通過して金屬に遠する場合。

$$dp_{1} = \varepsilon_{1}c_{1} \{ i - \varepsilon_{3}c_{3}i - \varepsilon_{2}c_{1} (i - \varepsilon_{3}c_{3}i) \}$$

$$\therefore \quad dp_{1}/i = \varepsilon_{1}c_{1} \{ 1 - \varepsilon_{3}c_{3} - \varepsilon_{2}c_{2} (1 - \varepsilon_{3}c_{3}) \}$$
(4)

17

谷添字 1, 2, 3 は吸着層の第一層目,二層目,三層目に翻することを示す。

前報⁹の實驗結果に於て,吸着層の水分子の電子狀態は氣相,液相の水分子の電子狀態と殆 んど變りがないことが決定出來たから、電子衝撃による水分子の解離確率 e は各吸着層の分 子に就ても略々同一であることが像想出來る。 各層の吸着分子の解離確率を同一として次式 の如く置く。

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon_3 = \varepsilon$$

 ε の値は c=1 と假定して第一圖の曲線 (1) に開して計算すると 4×10^{-4} molecule/electron 程度になるが ε がこれよりも大きくなるとしても、その高次の項は無現出來る程小さいから (3), (4) 式の ε の二次以上の項を消すと電子が第一, 第二, 第三の各層を通過する場合の脱 離能率 4p/i は夫々 第一層に於て $4p_1 = \varepsilon_1 c_1$

第二语
$$\Delta p_2 = \epsilon_2 c_2$$

第三语 $\Delta p_3 = \epsilon_3 c_3$

如くなる.

吸着分子層が單分子層,二分子層,三分子層をなす場合の電子の脱離能率 4p/i は特異値 3,6,9 を取ることが脱離曲線の特性より判つてゐる。各多分子層を電子が通過する場合の脱 離能率は各吸着層の脱離能率の和と考へて次式の如く置ける。

$$\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\mathfrak{P}}\mathfrak{H}\mathfrak{H} : \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\mathfrak{Z}\mathfrak{H}} : \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\mathfrak{Z}\mathfrak{H}} : \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{\mathfrak{Z}\mathfrak{H}} = \varepsilon_1 e_1 : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_2 e_2) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_2 e_2 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_2 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_1 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_3 + \varepsilon_3 e_3 + \varepsilon_3 + \varepsilon_3 e_3) : (\varepsilon_1 e_3 + \varepsilon_3 + \varepsilon$$

之を計算すると ら= = = い が得られる.

即ち水分子の多分子層が形成せられる場合には、各層の表面密度が同一である様な構造をと る必要がある。分子が斯様な排列をする為には吸着層は充填せられた狀態をとるから、吸着分 子層には突起した部分や吸着層の穴が存在し難い事を示してゐるものと考へられる。 この事 實は結晶面の生長の場合に於ても動力學的な考察より同様に推論されてゐる⁽³⁾。

吸着水分子層に於ける吸着素域 (Elementary space) の半徑の決定

既に述べた如く吸着水分子層は多分子吸着層を形成し、且つ吸着層は水分子をもつて充填せ

13) M. Volmer, Knuchk der Phasenbildung, (Steinkopff, 1939) 32.

198

Vol. XVII

られてゐるものと考へられる

斯様な多分子吸着層に低速電子を衝撃して吸着分子を脱離せしめ、その層の厚さの減少を測 定して自金吸着表面の吸着素域 (elementary space) の半径を決定し得た. 此實驗を行ふには 器壁吸着水分子が自金面に飛來することを極力避けなければならぬので、器壁を充分深く液態 空氣内に浸して. 吸着分子を完全に凍結して分子の移動を妨げた.

脱離曲線の特性(第二圖)より知られる如く術報電限 10.5 V より 18 V の範圍では 4p/i の 値は 3. 6. 9 の如き不連續的な倍數關係を示す. 4p/i 値が 3 である時には完全な單分子層 が形成せられることが想像出来るから、今任意に實驗を行つて 4p/i を測定すれば $\frac{1}{3}$ $\frac{4p}{i}$ の値より吸着層が幾分子層よりなるか決定し得る。 數分子層の厚さを有する吸着層に對して 10.5 V より 18 V の範圍で低速電子衝撃を行つて、決々に 4p/i の値を測定し、失々

$$\frac{dp_1}{i_1}, \frac{dp_2}{i_2}, \frac{dp_3}{i_3}, \dots, \frac{dp_n}{i_n} \ge \pm 3.$$

この場合、多分子層の厚さは夫々

$$\frac{\Delta p_1}{3i_1}, \frac{\Delta p_2}{3i_2}, \frac{\Delta p_3}{3i_3}, \dots, \frac{\Delta p_n}{3i_n}$$

となつて漸次減少する.

n 回の衝撃實驗を行つた後の層の厚さの減少は次式で表し得る。

$$\frac{1}{3}\left\{\frac{\Delta p_1}{i_1}-\frac{\Delta p_n}{i_n}\right\}$$

この間に脱離する氣體の量は下の如くなる.

$$\Sigma^{n-1}$$

 $\Sigma \Delta p_{n-1}$

随つて一層を形成する分子の数は脱離氣酸分子数を層の厚さの減少で除すると得られる.又 電子衝撃を蒙ける表面積を 8 とし、その單位面積に吸着する分子の数を n。とすれば、衝撃 を蒙ける表面に於て單分子層を形成する分子の数は noS であらはし得るから下の如き關係が 存在する。

$$2\sum_{1}^{n-1} \Delta p_{n-1} / \frac{1}{3} \left\{ \frac{\Delta p_1}{i_1} - \frac{\Delta p_n}{i_n} \right\} = u_0 S$$
 (6)

之を變形すると

$$\frac{1}{3} \left\{ \frac{\Delta p_{1}}{i_{1}} - \frac{\Delta p_{n}}{i_{n}} \right\} = \frac{2}{n_{0}S} \sum_{1}^{n-1} \Delta p_{n-1}$$
(6')

(6) 式のた邊の恒數2は吸着水分子が電子衝撃によつて II と OII に解離する場合に OH は液態を氣で冷却せられた器壁に完全に吸着凍結せられる¹⁰故に、二分子の水より一分子の水

No. 5

(原報)石川義興

Vol. XVII

素が生する事を示す。 随つて解離した吸着水分子の数は脱離水素分子の数の二倍となる。 (6') 式に於て $n_n S$ を除いては悉くの量が實驗的に測定し得る。今 $\frac{1}{3} \left\{ \frac{4p_1}{i_1} - \frac{4p_n}{i_n} \right\}$ 及 び $\sum_{i=1}^{n-1} 4p_{n-1}$ の二量を夫々座標にとつて作圖すれば原點を通る直線が得られる筈である。且つ 直線の傾斜より $n_n S$ を決定出來る。

斯る直線關係の存在することは第四圖 の二つの曲線に就て之を確めることが出 來た。第六圖は前記曲線に關する實驗値 を第一表より求めて(6')の關係式を圖示 したもので、原點を通過する直線上に實 驗的に求めた各點が乗つてゐるのが見ら れる。

單分子層を形成する分子數 n_oS はこの 直線の傾斜より知り得るから衝撃面積 S を實驗的に決定出來れば吸着素域 (elementary space)の大いさを決定出來る.然 し S は陰極纖錄より放出した電子が陽 極白金板を衝撃する面積であつて;.直接 に測定は困難であるし,又幾何學的に求 めた表面積に數倍する有效衝撃面積を取 らねば真の表面積を示し得ない.



Fig. 6. The linear relation between the desorption amount $\sum_{i=1}^{n-1} dp_{n-1}$ and the decrease of the thickness of the adsorption layer $\frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{dp}{i}\right)_{1}^{-1} \left(\frac{dp}{i}\right)_{n} \right\}$

(7)

.

熱電子放出の際の空間電荷の理論によれば、熱電子電流は空間電荷の影響を受けて次式に示 す如き電流を生する¹⁰・

$$i=2.33 \times 10^{-6} \frac{V^{\frac{4}{2}}}{d^2} S$$

d は兩極間の距離 (cm) で、S は陽極の有效衝撃面積 (cm³)。V は兩極間に掛けた電壓であ る、本實驗に於ける如く陰極に沿ふ電位變化 E5 が陽極電壓 V に比して無視出來ない程度の 電壓を持つ場合には、(7) 式より寧ろこの影響による補正を加へた下式がよく適用出來る¹⁰。

$$I = \frac{2.33 \times 10^{-6}}{d^2} V_{24} \left\{ 1 - \frac{3}{4} \times \frac{E_f}{V} \right\} S_{calc}$$
(8)

(8) 式に於て V は陽極電壓, Ef は加熱電流による陰極の兩端の電壓降下で,その實測値

i5) G. Kusunose, Proc. I. R. E., 17, 1706 (1929).

200

¹⁴⁾ I. Langmuir, Phys. Z., 15, 348 (1914).

Curve a.

201

は 3 V である. (8) 式を用ひて, i, d. V. Er が資測出來るから有效陽極面積 Seale の大いさ を決定出來る.

二極管壁を液體空氣に浸して試みた電子衝撃實驗,即ち第四圖の (a) 及び (b) 曲線に關し て,(6') 式及び (8) 式の計算に必要な實驗上の諸數値を整理して第一表に表示した。

No. of Impact	Δp	Σ Δ/	č i	$\left(\frac{\Delta f}{i}\right)_{n}$	$\frac{1}{3}\left(\frac{dr}{i}\right)_n$	$\frac{1}{3}\left\{\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{1}-\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{1}\right\}$),,}	V95	Scale (cm2)
1	2.4	2.4	0.20	5 11.7	3.9	0		36.5	0,12
- 92 -	1.5	3.9	-0.18	5 8.1	2.7	-1.9	8	36.5	-0,11
3	1.2	5.1	0.22:	2 5.4	1.8	2.1	:	\$6.5	0.13
4	0.9	6.0	0.200	0 4.5	1.5	2.4		36.5	0.12
-5	0.6	6.6	0.22	2 2.7	0.0	3.0	1	16.5	0.13
2	C	urve b,	Ş.	2° 2		r • 15 👷	3 Q.	- 1	
No. of Impact	C Ap	urve b.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	$\left(\frac{\Delta p}{i}\right) = \frac{1}{3}$	$\left(\frac{4r}{l}\right) \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{4r}{l}\right) \frac{1}{3} \right\} $	$\left(\frac{dp}{i}\right) - \left(\frac{dp}{i}\right)$	·v	V%	Scale (cm ²)
No. of Impact	C Ap	urve b,	<i>i</i> ($\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_n \frac{1}{3}$	$\left(\frac{\Delta f}{i}\right)_{n} \frac{1}{3}\left(1\right)$	$\left(\frac{dp}{i}\right)_{i} - \left(\frac{dp}{i}\right)_{N}$	v	V35	Scale (cm²)
No. of Impact	C م ا	urve b. <u>\$</u> 4\$ 1.31	i ($\frac{\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_n}{4.7}$	$\frac{\left(\frac{d\rho}{i}\right)_n}{1.57} \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{d\rho}{1.57}\right)_n \right\}$	$\frac{\left(\frac{dp}{i}\right)_{i}-\left(\frac{dp}{i}\right)_{n}}{0.}$	V 10.6	V¾ 34.3	Scale (cm ²) 0.171
No. of Impact	Сл 4р 1.31 1.16	urve b, <u> 5</u> <i>Ap</i> 1.31 2.47	<i>i</i> (0.37 0.33	$\frac{\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_n}{4.7} \frac{1}{3.5}$	$\frac{\left(\frac{df}{i}\right)_n}{1.57} \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{1}{3} \right)_n \right\} $	$\frac{\left(\frac{dp}{i}\right)_{i}-\left(\frac{dp}{i}\right)_{n}}{0.}$	V 10.6 11.6	V% 34.3 39.5	Scale (cm ²) 0.171 0.177
No. of Impact	ф 1,31 1.16 1.08	urve b, <u>Σ</u> Δρ 1.31 2.47 3.55	<i>ī</i> (0.27 0.33 0.38	$\begin{array}{c c} \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_n & \frac{1}{3} \\ \hline 4.7 \\ 3.5 \\ 2.8 \end{array}$	$\left(\frac{dp}{i}\right)_{n} \frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{dp}{i}\right)_{n} \frac{1}{3} \right\} $	$\frac{\left(\frac{dp}{i}\right)_{1}-\left(\frac{dp}{i}\right)_{n}}{0.}$ 0.4 0.64	V 10.6 11.6 12.6	1/35 34.3 39.5 44.7	Scale (cm ²) 0.171 0.177 0.177
No. of Impact	<i>که</i> 1.31 1.16 1.08 0.90	1.31 2.47 3.55 4.45	<i>ī</i> (0.37 0.33 0.38 0.41	$\frac{\left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{n}}{4.7}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{4.7}{3.5}$ 2.8 2.15	$\frac{\left(\frac{dp}{i}\right)_{n}}{1.57} \frac{\frac{1}{3}}{1.17} \frac{1}{0.93} \frac{1}{0.71}$	$\frac{\left(\frac{dp}{i}\right)_{1}-\left(\frac{dp}{i}\right)_{N}}{0.}$ 0.4 0.64 0.86	V 10.6 11.6 12.6 13.5	1/35 34.3 39.5 44.7 49.6	Scale (cm ²) 0.171 0.177 0.177 0.177
No. of Impact 1 2 3 4 5	<i>Ap</i> 1.31 1.16 1.08 0.90 0.73	x x x 1 3.1 2.47 3.55 4.45 5.18	i (0.27 0.33 0.38 0.41 0.52	$\frac{(\Delta p)}{i}_{n} \frac{1}{3}$ 4.7 5.5 2.8 2.15 1.4	$\frac{\left(\frac{dp}{i}\right)_{n}}{1.57} \frac{1}{3} \left\{ \left(\begin{array}{c} \frac{dp}{i} \\ 0.93 \\ 0.71 \\ 0.47 \end{array} \right) \right\}$	$\frac{\left(\frac{dp}{i}\right)_{1}-\left(\frac{dp}{i}\right)_{N}}{0.}$ 0. 0.4 0.64 0.86 1.10	V 10.6 11.6 12.6 13.5 15.5	V34 34.3 39.5 44.7 49.6 61.0	Scale (cm ²) 0.171 0.177 0.177 0.177 0.170

Table 1.					
Numerical	Values	of	Experiments	on	Impact.

曲線(a)は第一表に示される如く一定簡整追座(11V)に依つて脱離實驗を行つた場合の一例である。表に見る如く(8)式を用ひて計算して得た Saue は 0.125 cm² を示す。

曲線 b は衝撃電壓を 10.6 V より 18.5 V 迄頓次に變じて脱離實驗を行つた一例である。こ の衝撃電壓範圍では衝撃電子の解離確率は大して變化しない。 第一表に見る如く衝撃電壓及 び電流が可成變じてゐるに拘らず。(8) 式を用ひて計算した衝撃面積 S_{ad} は一定値 0.17 cm² を示してゐる。以上の方法により S_{adc} を計算すれば、 u_0S の値は第六圖の直線の傾斜より決 定出來るから之より $\frac{S_{adc}}{n_0S} = \frac{1}{n_0}$ を計算することが出來る。 $\frac{1}{n_0}$ は吸着分子一個が占有する 白金表面積に相當する。 n_0S の單位は電流計の振れ (cm) として表はされてゐるから、ビラ = 眞容計の感度 10⁻⁶ mm.Hg とし、 眞容計及びそれに連絡する導管の部分の總容積を 200 cc とすると、脱攀水素分子の数が正確に計算出來るから之より n_0 を決定出來る。 更に $\frac{1}{n_0}$ = πr^2 として吸着分子層の吸着素域の半徑を計算することが可能である。

以上の實驗及び計算より吸荷素域の半徑を決定すると、a 曲線よりは 1.17 Å が得られ、b 曲線より 1.0 Å が得られた。 (原報)石川義興

Vol. XVII

.

水分子の半徑の測定は種々の方法に依つて行はれ、第二表は種々の方法で求めた半徑の大さ を示す¹⁶⁾。

	Radii	Experimental Methods			
1	2.29	From data on :	Viscosity, heat conductivity and diffusion.		
I	1,36		Viscosity.		
-71	1.44		Volume correction in van der Waal's equation		
Ŋ	1.17		Volume correction in Wohl's equation.		
ŶΥ	0.67		Quenching of mercury fluorescence.		
V	1,38	3	X-ray analysis of the structure of ice.		

Table II. Molecular Radii of Water Molecule in A Units.

實驗的に求めた吸着素域の半徑 1.17 Å は従来の實驗結果 1.38 Å に可成よく一致する。著 者の實驗に於て二極管の兩極間の實測距離を 0.2 cm としたが、この距離の精密な測定は困難 である。又表面吸着分子の移動は極力避けねばならぬがこの移動を完全に止めることは實驗 上極めて困難である。移動が超れば吸着素域を減少する様な影響を及ぼすから、上の半徑の差 は此様な實驗誤差に基くものと考へられる。

然し自金表面の吸着水分子の吸着素域の半徑が水分子の半徑に略等しいことは吸着層に於 て分子が充塡せられた狀態に排列してゐることを示すもので、前項に於ける第(5)式の示す 吸着層の構造が正しいことを證明してゐる。

更に第二層,第三層に於ても全く同様な充填した排列を取り得る事は第六圖の直線關係が數 分子層の範圍に互つて存在する事から之を證明出來る.

以上よりして水分子は多分子層に吸着して各層は空所のない充塡した排列を取り,相隣つて ゐる分子間の距撞は水分子が水素結合をなす時の距離に等しい程度に 近接してゐることが判 る.又吸着層表面に於ても缺所や著しい突起部分は存在してゐないことが推論出來る。

吸着層の性質

i) 多分子吸着層の安定性

二極管に水の蒸氣を導入した直後に於ては電子衝撃實驗より求めた 4p/i 値は 260 以上をも示して,分子層の厚さは 90 層にも達してゐるものと思はれる。然し斯る厚い吸着層は低壓に於て吸着水分子が蒸發して層の厚さを減少し,長時間の排氣後には單分子層一高々數分子層一を生じて割合に安定に存在してゐる。斯樣な吸着層は前項に述べた如く,吸着分子が一種の結

202

 ¹⁶⁾ Landolt-Börnstein. Physikalisch-chemische Tubellen, Erg. Bd. I, (1927) 69.
 A. C. G. Zemansky and M. W. Mitchell, Resonance Radiation and Excited Atoms (Cambridge, 1934).
 W. H. Barnes, Proc. Roy. Soc., A 125, 670 (1929).

晶的な 排列を示すものと考へられ、その表面には突起部分や 吸着分子の缺けた穴は存在しない。

結晶表面に於ける構成分子或は原子はその存在する位置(稜,角,面等)に依つて位置のポテ ンシャルエネルギーを異にする事實が考察せられてゐる。 即ち平滑な面上に孤立して存在す る分子の結合エネルギーは 平滑な面を構成してゐる 分子の結合エネルギーに比して甚だ小さ い. 同様なことが結晶面の種々な 位置に存在してゐる 他の分子 或は原子に就ても 考へられ る¹³⁾.

水の吸着層を一種の結晶構造を有するものと考へると、器壁より飛來した水の分子が平滑な 吸着層上に吸着せられても、その結合のエネルギーは完全に平滑な吸着層を構成する水分子の 結合エネルギーに比して少であるから單時間しか表面に止り得ない. 又附近に吸着層の穴が あれば移動して結合エネルギーの大きな空所を充填することも考へられる. 之に反して平滑 な吸着面を構成する水分子は結合エネルギーが大であるから,吸着面に穴を作つて脱離する確 率は非常に少ない. 随つて氣相の蒸氣壓が極めて低いときには穴を持たない平滑な吸着層が 安定に存在し得る. これより,脱離曲線の第二,第三の特性が生する理由を說明することが出來 る.

斯る安定な吸着層に低速電子の衝撃を長時間續けても,吸着分子の脱離によつて生じた吸着 層の穴は器度吸着分子の飛來して之を補充する傷に, 4p/i 値は第三間に示す如く長時間に互 つて一定値を保つてゐるが. 飛來分子が減少して比較的に大きな穴を生じた場合に大なる穴に 隣る分子の結合エネルギーは小穴に隣るものに比して小さいから,穴を益ゃ大になる傾向を生 じ,比較的短時間の後には次の平滑な吸着面が顯れて之が安定化することが想像される. 4p/i 値の9より6に急に變する現象を第三間に見たが上の如き機構に基くものと考へると 説明出 來る.

ii) 水素分子の吸着水分子層への舉動

No. 5

水の吸着層へ水素を導入接觸せしめた後、水の脱離曲線の形の變化より水素の共存吸着の成 否を見た. 第一圖の (1), (2), (3) の曲線に相當する水の吸着層に於ては水素の同時吸着は 認められないが、第五圖より瞭らかな如く, 同時吸着の可能な場合は 4p/i の値が1附近の場 合である. 4p/i=3 に於て單分子層が完成せられてゐるものと考へられるから, 4p/i=1 に於 ては白金表面の約1/3 が水分子によつて蔽れ、残り2/3 は未吸着部分である. 水素は斯る白 金板の未吸着部分に吸着して水分子と同時に吸着するものと考へられる. 4p/i が更に増加し て3 に近づくと白金の未吸着部分を滅じて遠ひには 4p/i=3 に於ては水の單分子層が形成せ られ、最早水素の吸着は生じない. 水素は白金面には吸着し得るが, 水の吸着層上に更に吸着 することはない. 斯る吸着分子間の結合力に關して後に述べる.

Vol. XVII

白金表面の水の吸着層と二極管壁の吸着層の關係

自金表面吸着層に二時間以上も連續して低速電子衝撃を加へ,計算よりすれば數十分子層に 相當する吸着水分子が脱離してゐるに拘らず, 4p/i 値は常に一定して,二分子層,三分子層が 安定に存在することを示してゐる(第三圖參照). 之が原因は器壁吸着分子の飛來して補充す ることによるものと考へられるが次の實驗事實は之を證明してゐる. 實驗の項に述べた如く 補給源である器壁に對して加熱處理及び液態空氣による凍結の二方法を用ひ,其の補給を妨げ ると自金吸着水分子層の厚さを急激に減少する. ガラス表面が自金板に比して甚だ大きい表 面積をもつてゐること及びガラス表面には一種のシリカゲル状態になり 多量の水分子を吸着 吸藏し得る事を考へる¹⁹と補給量の大なる理由が說明出來る.

従つて白金吸着層とガラス器壁の水の吸着層の間には常に吸着平衡が存在してゐるものと 考へられる。

白金板上の水素吸着層と水の吸着層の差異

水の吸着層に電子鋼撃を加へた場合には第一闘に示す如く高さを異にする脱離曲線を三種 類生じた。然るに水素を吸着させた場合には一種類の脱離曲線しか得られない¹⁰。

既に述べた如く脱維曲線の高さを異にするのは多分子層吸着を生じてゐる結果であるから 水素の吸着の場合には水の吸着の如き多分子層を形成せず單分子層を形成することが判る、又 この事實は水素と水の同時吸着の際の脱離曲線の傾向よりも推論出來る。

水の吸着居に開して第一式を用ひて s の大さを計算し、 衝撃電子の解離確率を計算すると 10.5 V より 15 V の範圍では絶對牧量 3.8×10⁻⁴ molecule/electron であることが判る。

吸着水素分子の ${}^{1}\Sigma_{g} \rightarrow {}^{3}\Sigma_{u}$ 励起の際の絶對牧量は實驗的に 6.4×10^{-5} molecule/electron 程度であることが知られてゐる¹⁰⁾.

水素の場合に吸着密度を1と假定すると、吸着水分子と吸着水素分子の電子衝撃による解離 確率は6倍に近い差があることが判る。

實際吸着氣體の脫難實驗を行つた場合に、器壁を液態空氣に浸すと水の吸着層に於ては第四 圖に示す如く、毎回の衝擊實驗後に脫離曲線が著しく降下して表面密度の急激な減少が生じ てゐることを示すが、吸着水素分子の層に於て斯る表面密度の著しい減少は顯れない。

この差異の生する原因として、第一は水素の電子による 解離確率は 水の解離確率に比して。 1/6 の程度少で實驗時に於ける脫離量が少ない。

第二は水素分子の大いさが水のそれに比して小さいから表面の吸着分子数は水に比し大で ある事も理由として考へられる、今後の實驗に於ても形の大きい解糠確率の大きな分子はその 脱難曲線は表面密度の影響が著しく顧れて、脱離曲線の急激な減少が豫想され、實驗上測定が 困難と思はれる。 この場合にはビラ=感度を更に高めて少ない脱離量を以て實驗を行ふ必要

No. 5

205

がある.

吸着分子層に働く力

氣體分子が白金表面上に吸着する場合に,吸着氣體の種類によつて分子層の厚さに差を生じる。即ち,水素が白金板に吸着せられる時には單分子層しか生じないが,水分子の吸着層は多分子層を形成する。 斯る吸着層の厚さの差を生じる理由は當然分子層に働く力の差異に悲くものである。

單分子層が形成せられる際には、金属表面と吸着分子の間の力が主であるが、多分子層に於 ては、層を形成する吸着分子相互間の力が重要になる.

金屬表面に氣體分子が吸着して、之と化學結合を生じない場合、或は吸着分子の角離を伴は ない場合は、斯る吸着はヴァン・デル・ヴ,ールス吸着の名で呼ばれ、之の結合力はヴァン・デル・ ヴァールス力によるものである。この力は近時、量子理論の解明に¹⁷依つて力の本性が明らか にせられ、配位 (orientation effect)、誘起 (induction effect) 及び分散 (dispersion effect) の三效果 より生ずる力の各々の寄與も計算せられてゐる。 初めの二つの效果は靜電氣力による古典論 的な力¹⁸⁾であるのに反して、分散力は新しい量子力學的な效果で、無極性分子の金属表面に於 ける吸着力の基因とせられてゐる¹⁰⁰.後者の吸着力に闘しては、金属の特性を考慮した計算が 行はれ、金属表面に於ける分子吸着の研究はこの方面より解決されつゝある。

併し分散力は距離の六乗に逆比例して、減衰するから金属表面と吸着分子間の力は距離の増 大に伴つて著しく減少し、多分子層が形成せられる際には吸着分子間に働く力が重大な影響を 現はす様になる。斯る多分子層の構造は一種の分子性結晶に類似したものと考へられる。そ の層形成のエネルギーを分子性結晶エネルギーと同様に、分散力によるものとすると分子性 結晶の昇華熱の程度となり、酸素、窒素の如き無極分子に於ては 2 Kcal/mol 以下となつて 實際多分子層形成が困難な理由を說明出來る。

水分子に於ても分散效果は甚しく大ではないから、この力のみで多分子層吸着を生じ得ない。 併し水及びアンモニャの如き有極性分子に於ては配位效果が可成大である。 配位效果に 基く力はその力の性質が加算的 (additive) でないから一般に多分子層を形成する様な大きい 凝集力を期待することは出來ない³⁰。

20) H. Margenau, Rev. Mod. Phys., 11, 1 (1939).

¹⁷⁾ F. London, Z. Physik, 63, 245 (1930).

W. H. Keesom, *Physik. Zeits.*, 22, 129 (1921).
 P. Debye, *ibid.*, 21, 178 (1920).

<sup>J. E. Lennard-Jones, Trans. Forud. Soc., 28, 333 (1932).
J. Bardeen, Phys. Rev., 58, 727 (1940).
H. Margenau and W. G. Pollard,</sup> *ibid.*, 60, 128 (1941).

(原報) 石川 義 興

Vol. XVII

水紊結合

206

水分子が多分子層を形成するには ヴァン・デル・ヴァールス 力以外の何等かの引力の存在が 豫想される.

一般に水,アンモニヤ分子等に於ては水素原子に基く水素結合(hydrogen lond)の存在が 古くより知られてゐる。

この力の本性に關しては,双極子效果を否定した水素原子交換機構の如き極端過ぎる考へ方 も存在するが,兎も角,その力の型は,結合機構の嚴密な決定的な記述が困難な過渡的な型式 に屬するものであらふ**)、従つてその力の大いさの如きも正確な計算は不可能である.

Pauling の問題の昇華熱等よりする大膽な撤算によれば, 水の水素結合のエネルギーは約45 Kcal アンモニヤ分子の夫は 1.3 Kcal と推定せられてゐる⁹⁰, 先の分散力に比して, 可成大き い値を示してゐるので、多分子層形成の基因として有力に作用するものと考へられる。

斯る水素結合が多分子吸着層の起因と 考へられる實驗的な事實として 次の事質が舉げられ 2.

水素結合が作られる場合には水分子が 2.5 Å-2.9 Å の距離に存在してゐることが知られて ゐる。 水素結合の存在にはこの程度の分子の近接が必要と考へられる。 實驗的に多分子吸着 層に於て水分子間の距離は 23A 程度と考へられるから 斯る近接吸着分子間に充分水素結合 の存在が豫想出來る。

更に,實驗結果より知られる如く水分子の多分子吸治層は規則正しい排列を取つて層を形成 してゐることが判る。 斯る吸着層の構造は一種の結晶的な性質を有するものと考へられ, 氷の |結晶構造と 闘聯して考へるべきであらふ。氷に於ては,水分子の酸薬が 四面體的配置を取つ て、その間を水素結合によつて結合せられてゐる³³⁾。多分子吸着層に於ても水分子はとれに類 似した配置をとつて層をなすことが豫想され,水薬結合が之等の吸着分子を比較的に强く結合 するものと考へられる。

又實驗的に水の吸着層上には水素の吸着層を生じないことが判つたが,水素分子の如き,電 氯的陰性度の少なる原子よりなる分子に於ては,吸着層を形成する水分子との間には弱い分散 力が働くのみで、水素結合の如き結合力を生じない・従つて水素は水の吸着層の上に吸着出來 ないことが説明出來る.

以上の事實は著者の實驗より 水素結合の存在を豫想せしめるものを 擇んだのであるが,尙

111

4 36

23) D. M. Dennison, Phys. Rev., 17, 20 (1921). $\sum_{k=1}^{\infty} (1-x_k)^{\frac{1}{2}} = \sum_{k=1}^{\infty} (1-x_k)^{\frac{1}{2}$ W. H. Bragg, Proc. Phys. Soc., 34, 98 (1922).

W. H. Barnes, Proc. Roy. Soc., A 125, 670 (1929).

²¹⁾ L. Pauling, The Nature of the Chemical Bond (Cornell press, 1940) 284.

²²⁾ G. Briegleh, Zwischenmolekulare Kraft und Molekülstruktur (Ferdinand Enke, Stuttgar 1937), 73.

低速電子衝撃による吸着氣體の脱離(第4報)

:207

水の吸着實驗に於て吸着熱の測定が行はれてゐる.

水が活性炭表面に吸着する際の微分吸着熱は 11.4 Kcal-9.5 Kcal/mol なるととが測定せら れた³⁰. 氷の昇華熱は 12.2 Kcal/mol であり,水の蒸發熱は 10.4 Kcal/mol であることが知ら れてゐるから,水が活性炭に吸着する場合に單なる分散力によつて吸着するのではたく,可成 强く,水素結合が働らいてゐることが判る。從つて吸着層が數分子層を形成する場合には水素 結合によつて結晶的な構造を取ることが豫想され得る。

以上述べた理由により水分子の多分子層吸着を生するのは吸消分子間に水素結合による力 が働いて、單なる分散力よりも强い結合をなすことに依るものである。

一般に吸着分子が多分子層吸着を生する為には分散力以外に可成り大きな分子間の力の存在することを必要とする。 水素結合の如き特種な分子間の力は之が基因として有力に働くものと考へられる。

要 約

以上實驗結果を要約すれば、自金表面に水分子が吸着する場合、水の蒸氣脈が飽和に近い様な壓に於ては、百分子層以上の厚い吸着層を生じ凝縮すら生するが、充分排氣した自金面に於 ては單分子層を主として生じ時には數分子層の厚さを有する多分子吸着層を安定に生する。

水素分子が單分子層のみを生するのに反して,水分子に於ては容易に多分子層が形成せられる.

斯る水分子の多分子層に就て、その有する種々の特性を調べたが、斯る數分子層の厚さを有 する吸着層は結晶的な排列を示すものであることを明らかにした。

吸着層が斯る結晶的な構造をとるのは、之を構成する吸着分子間に分散力以上の强い凝集力 の存在を豫想させるが、之が水素結合に基くものであらふと推論した。 實際吸着層の有する 種々の物理化學的な性質はこの力の存在を證明してゐる。

又斯る肖金板上の吸着層は器壁の水の吸着層と密接な關係を有するもので、この兩者の間に 吸着平衡の存在する事實を瞭らかにした。

本實驗を行ふに當り,終始御愁篤な御指導を賜はつた堀場先生に厚く感謝申上ます.又研究 費の補助を戴いた帝國學士院に感謝の意を表します.

> 京都帝國大學理學部化學教室 物理化學研究室

(昭和18年8月15日受理)

24) A. S. Coolidge, J. Am. Chem. Soc., 49, 708 (1927).

THE DESORPTION OF THE ADSORBED GASES BY THE IMPACT OF SLOW ELECTRONS. (IV)

The Determination of the Elementary Space and the Thickness of an Adsorbed Molecular Layer of Water.

By YOSIOKI ISIKAWA.

(Abstract)

By measuring the desorption of the adsorbed water molecules by slow electron impact, the present author has succeeded in deducing both the elementary space and the thickness of the layer of the adsorbed water molecules without measuring the area. He establishes that the adsorption of the water molecules upon a platinum plate is in the form of a mono-molecular —tri-molecular at the highest—layer under very low pressures, except in the case of the pressure of the adsorbate approximating to the saturated vapour pressure, when the formation of thicker layers and even condensation in bulk may occur.

Experimental Results and Discussion.

The apparatus and procedure used are the same as given in the preceding papers. (*This Journal*, 16, 86, 119 (1942), 17, 176 (1943).)

In the report, the author makes clear that the desorption phenomenon is due to the dissociation or predissociation of the molecules by electron impact.

The number of the collisions between the adsorbed molecules and electrons, which cause such dissociation and predissociation is proportional to the fraction of the surface covered with the adsorbed molecules e and the electron current i. Accordingly the desorbed amount Δp can be expressed thus:

$$\Delta p = \epsilon \cdot c \cdot i$$

where ε is the probability of dissociation by an electron impact. $\Delta p/i$: the height of the desorption curve is equal to the product of the dissociation probability ε and the adsorbed fraction *c*. In Fig. 1, however, the three desorption curves are found to differ in height, and in Fig. 2 the height, $\Delta p/i$, is seen in such a multiple relation as 3, 6 and 9.

Such discontinuity of the value of $\Delta p/i$ is due to that of the fraction of the covered surface *e* proportional to $\Delta p/i$. On a metal surface where the same atoms are arranged uniformly and two-dimensionally, though with some irregularity, it is not admitted that a monomolecular layer is discontinuously built up by the successively adsorbed molecules. The cause of such discontinuity is to be sought in the multiplicity of the structure of the adsorption

低速電子衝撃による吸着氣體の脱離 (第4報)

layer.

The curves, (1), (2) and (3) in Fig. 1 are considered to correspond to the mono-molecular layer, di-molecular layer, and tri-molecular layer respectively.

As for such multi-molecular layers, let the fractions of the adsorbed surfaces of the first, the second and the third layers be represented by e_1 , e_2 and e_3 respectively. Suppose that the electron current *i*, after bombarding the layers and passing through them, reaches the interior of the metal. The ratio of the desorption efficiency dp/i of electrons concerning the mono, di- and tri-molecular layers are as follows:

$$\left(\frac{dp}{i}\right)_{\text{mono}}\left(\frac{dp}{i}\right)_{\text{di}}: \left(\frac{dp}{i}\right)_{\text{tri}} = \varepsilon_1 \varepsilon_1: (\varepsilon_1 \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \varepsilon_2): (\varepsilon_1 \varepsilon_1 + \varepsilon_2 \varepsilon_2 + \varepsilon_3 \varepsilon_3) = 3:6:9.$$

On calculation, we obtain $c_1 = c_2 = c_3$. This shows that the adsorbed surface fractions of the multi-molecular layers formed are quite the same. Such arrangement of molecules requires a fully packed adsorption layer: namely such an adsorption film has scarcely any attachment and hole.

As seen in Fig. 4 when the adsorbed molecules on the diode wall are frozen out to prevent vaporization, $\Delta p/i$ values decrease after each experiment on slow electron impact. It is presumed that when $\Delta p/i$ value reaches 3, the platinum plate is covered with a mono-molecular layer of water moleculs, so that $\frac{1}{3} \frac{\Delta p}{i}$ corresponds to the thickness of the adsorption layer. The measurements of the decrease of the thickness of the adsorption layer by a series of electron impacts $\frac{1}{3} \left\{ \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{1} - \left(\frac{\Delta p}{i}\right)_{n} \right\}$, of the desorption amount $\sum_{i=1}^{n-1} \Delta p$ and of the effective anode area S determine the radius of the elementary space of the adsorbed water layer by the relations, (6, 8) and its radius calculated 1.2 Å long is in fairly agreement with that of a water molecule 1.3 Å long from X-ray analysis of ice.

When a mono-molecular layer has been formed, a further heating and pumping produces an uncovered part on the platinum surface. As seen in Fig. 5, the introduction of hydrogen changes one into an adsorption layer where the molecules both of hydrogen and water exist simultaneously. This formation is possible only in the case when $\Delta p/i$ is smaller than 3.

In spite of the desorption quantity caused by more than 2 hours' electron impact which corresponds to several square centimeters mono-molecular film by calculation, the value of $\Delta p/i$ remains unchanged as seen in Fig. 3 and the film on the metal is not decreased in thickness. Nevertheless, the heating and pumping treatment of the wall of the diode above 200°C instantly decreases the value of $\Delta p/i$ below 2, that is, it decreases the thickness of the layer. It is considered that as soon as the adsorbed molecules on the metal are desorbed in consequence of electron impact, these are probably made up by the molecules adsorbed on the diode wall. When the adsorption layer of water on the wall is frozen with liquid air, the value of $\Delta p/i$, as seen in Fig. 4 becomes smaller by a series of electron impacts, and the constancy of the value of $\Delta p/i$ as in Fig. 3 is not maintained so long. This fact indicates that

No. 5

209

(原報)石川義興

Vol. XVII

there exists an adsorption equilibrium established between the adsorbed films on the metal and the wall.

The suggestion is made that the cause of the occurrence of multi-molecular adsorption is that between the adsorbates there are exerted strong forces of intermolecular attraction which reside in the formation of the hydrogen bond.

The Laboratory of Physical Chemistry, Kyoto Imperial University.

• •

(Aug. 15, 1943)

210

.